(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 29. März 2001 (29.03.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/22477 A1

(51) Internationale Patentklassifikation?:

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/09177

H01L 21/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. September 2000 (20.09.2000)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 199 45 648.8 23. September 1999 (23.09.1999) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): STEAG HAMATECH AG [DE/DE]; Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sternenfels (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WEBER, Klaus [DE/DE]; Friedenstrasse 58, 75015 Bretten (DE). SĀ-MANN, Martin [DE/DE]; Altheckenstrasse 8, 75443 Otisheim (DE). KALLIS, Jürgen [DE/DE]; Hindenburgstrasse 49/1, 75417 Mühlacker (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, IL, JP, KR, SG,
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht:

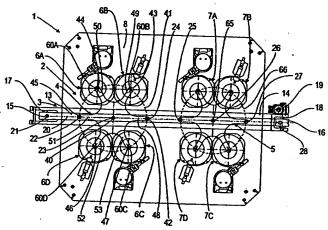
Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR LOADING AND UNLOADING SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM BE- UND ENTLADEN VON SUBSTRATEN



(57) Abstract: The invention relates to a device (1; 1a; 1b) for loading and unloading of substrates using a conveyor device (83; 3a; 3b) which is used to convey a substrate in a linear manner comprising at least one handling facility which can be rotated (4, 5; 4a) and which is intended for the transport of said substrate between said conveyor device (3; 3a; 3b) and at least one process station (6A to D, 7A to D; 80A to H) wherein a small number of components are used and a small amount of space is taken up when the conveyor device (3; 3a; 3b) is arranged between at least two process stations (6A to D, 7A to D; 80A to H) and the at least one handling facility

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]